平成26年度科学技術人材育成費補助事業「科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事業」

Nanotech CUPAL

ナノテクキャリアアップアライアンス

Nanotech Career-up Alliance（Nanotech CUPAL）※は、新たな知の創生を牽引するプロフェッショナル（Nanotech Research Professional: NRP）と、イノベーション創出を牽引するプロフェッショナル(Nanotech Innovation Professional: NIP）の育成を目的としています。

NRPコースでは、主体的に新たな知の創生を牽引する次世代研究人材の育成を目指し、先進的かつ独創的な研究テーマを提案した育成対象者に対し、共同研究や国際レベルでの人的交流などの機会を提供し、キャリアアップの可能性を広げるためのサポートをします。

NIPコースでは、イノベーション創出を牽引するスペシャリストの育成を目指し、ナノテク分野における研究開発の基盤となる種々の要素技術の高度なレベルでの習得とその実践的トレーニングの場を提供します。

※我が国のナノテク研究人材のキャリアアップと流動性向上を図るため、ナノテクノロジー分野における産学官の共鳴場であるオープンイノベーション拠点「TIA」と京都大学ナノテクノロジーハブ拠点が連携し人材を育成する事業です。

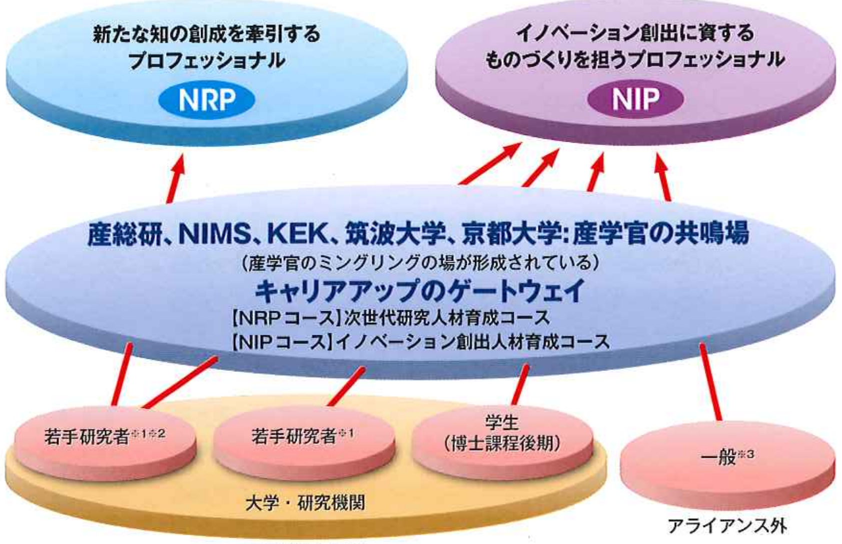
●アライアンスの構成

アライアンスは、A機関（育成実施機関：産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構、筑波大学および京都大学）とB機関（研究者等派遣元機関：10大学）で構成されています。

NRPコースにはアライアンス内の若手研究者（助教・ポスドク等）、 NIPコースにはアライアンス内の若手研究者・博士課程後期学生等およびアライアンス外の研究者が参加できます。

下図「各コースの概要図」を参照してください。

●各コースの概要図



※1：博士号取得後10年以内又は同等程度の研究経歴（博士課程に標準年限以上在学し、所定の単位を修得した上、退学した者で退学後10年以内）を有する若手研究者（40歳未満。）

※2：自立した研究ができる環境が確保されている事が条件

※3：有料

平成 29 年度 Nanotech CUPAL NIP コースの詳細は裏面へ

Nanotech Career-up Alliance CUPAL

お問い合わせは Nanotech CUPAL 事務局へ

詳しくはホームページをご覧ください。

https://nanotechcupal.jp/

スマホ、タブレットの方は▶コチラからどうぞ。

平成29年度 Nanotech CUPAL NIPコース

	コース名		募集人数	実施回数
産総研	TCAD実習初級(+中級)コース		10名	1回/年
	SCR 超微細加工プロセスコース		各3名	2回/年
	MEMS 2週間コース		5名	1回/年
	TIAパワーエレクトロニクス・サマースクール		10名	1回/年
	MEMS 5日間コース		各4名	2回/年
	透過型電子顕微鏡による高分子試料解析技術入門コース		各5名	2回/年
	先端量子(X線・陽電子)ビーム分析法		3名	1回/年
	光周波数計測技術「入門」コース		3名	1回/年
	糖鎖プロファイリング初級コース		各5名	2回/年
NIMS	先端計測技術入門コース(TEM)	FIBによる断面試料作製	10名	1回/年
		イオンミリングによる断面試料作製	10名	
		TEM操作の基本	10名	
		TEM/STEM・EELSの基礎	10名	
	先端計測技術上級コース(TEM)	TEM/STEM観察・分析技術	通年2名	2回/年
		収差補正TEM/STEM技術	通年2名	
		STEM-EDS/EELS分析技術	通年2名	
	先端計測技術入門コース(表面解析)	超高真空走査型トンネル顕微鏡の初歩	各3名	4回/年
		表面分析の初歩	各3名	
		走査型ヘリウムイオン顕微鏡の初歩	各3名	
	先端計測技術上級コース(表面解析)	極高真空低温SPM法	通年2名	2回/年
		表面解析PEEM/MEEM法	通年2名	
		Heイオン顕微鏡	通年2名	
	先端計測技術入門コース(構造解析)	X線・中性子粉末構造解析法の初歩	各6名	4回/年
		小角X線散乱計測法の初歩	各3名	
		X線反射率法の初歩	各3名	
		核磁気共鳴実験の初歩	各3名	
	先端計測技術上級コース(構造解析)	粉末回折法	通年2名	2回/年
		小角/極小角X線散乱法	通年2名	
		薄膜・多層膜X線反射率法	通年2名	
		固体NMR計測法	通年2名	
KEK	放射光利用技術入門コース		各10名	2回/年
	放射光分析技術上級コース		3名	随時
筑波大学	放射線計測実習コース	陽電子消滅コース	各2～4名	2回/年
		メスバウアー分光コース	各2～4名	
	高機能ナノ微細加工実習コース	MOSキャパシタの作製と電気特性評価コース	各3～5名	2回/年
		FIB技術実践コース	各3～5名	
		EB描画による微細パターン形成実習コース	各3～5名	
		μTAS実践コース	各3～5名	
	加速器・イオンビーム分析実習コース	加速器質量分析(AMS)コース	各2～4名	2回/年
		表面分析(RBS/ERDA)コース	各2～4名	
		軽・重元素分析(PIXE、NRA)コース	各2～4名	
	ナノエレクトロニクス・ナノテクノロジーサマースクール		※5名	1回/年
	ナノグリーン・サマースクール		※5名	1回/年
	先端計測・分析サマースクール		※5名	1回/年
	サマーレクチャー		各科目※5名	1回/年
京都大学	電子線描画装置入門コース		3名	1回/年
	電子線描画装置アドバンストコース		3名	1回/年
	MEMSコース		各3名	前期・後期
	マイクロ・ナノスケール材料工学コース		3名	1回/年
	圧電デバイスコース		3名	1回/年
	フォトニックコース		3名	1回/年

※ Nanotech CUPAL の補助対象者の募集人数は 5 名。一般参加を含む募集人数は 30 名（サマーレクチャーは各科目 30 名）